# MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT AND DEVICE **THEREOF**

Patent Number:

JP8095066

Publication date:

1996-04-12

Inventor(s):

NISHIYAMA KAZUHIRO;; ASAYAMA JUNKO;; TAKIMOTO AKIO

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19940231030 19940927

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1339; G02F1/13

EC Classification:

Equivalents:

JP3189591B2

☐ JP8095066

#### Abstract

PURPOSE: To uniformly scatter spacers on the surface of a substrate by dropping down the dispersion solution of spacers on the surface of the substrate, and rotating the substrate. CONSTITUTION: A substrate 6 is fixed to a rotatable stage 7, dispersion liquid 2 dispersing spacers 1 therein is dropped down on the surface of the substrate through a vessel 3, a connecting pipe 5, and a nozzle 4, the substrate 6 is rotated, and hence the spacers 1 are uniformly scattered on the surface of the substrate 6. This scattering method is very effective for scattering of the spacer of about 1&mu m

size which is hitherto difficult.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-95066

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 F 1/1339 1/13 500 101

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

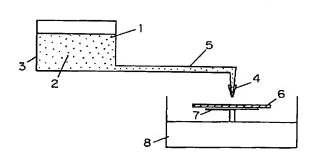
(21)出願番号	特願平6-231030	(71)出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22) 出願日	平成6年(1994)9月27日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 西山 和廣
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 朝山 純子
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 滝本 昭雄
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 液晶素子の製造方法及びその装置

## (57)【要約】

【目的】 基板表面にスペーサーの分散溶液を滴下し、 基板を回転させることにより、基板表面に均一にスペー サーを分散することを目的とする。

【構成】 回転可能なステージ7に基板6を固定し、スペーサー1を分散した分散液2を容器3、連結管5、ノズル4を通って基板表面に滴下し、基板6を回転させることにより、基板6の表面に均一にスペーサー1を分散する。この分散方法は、従来難しかった $1\mu$ m程度のスペーサーの散布にも非常に有効である。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】溶媒中に分散したスペーサーを前記溶媒と 共に基板上に塗布し前記基板を回転させ溶媒を蒸発さ せ、前記基板上に均一に前記スペーサーを分散させる工 程を有することを特徴とした液晶素子の製造方法。

【請求項2】溶媒中に分散したスペーサーを前記溶媒と 共に高速で回転させた基板上にスプレーした後、さらに 基板を回転させ溶媒を蒸発させ、基板上に均一にスペー サーを分散させる工程を有することを特徴とした液晶素 子の製造方法。

【請求項3】基板を固定し回転するステージと、前記ス テージの上部に液体を滴下することができるノズルと、 前記ノズルと連結したスペーサーを分散させた溶液を保 持する容器とを備えたスペーサーの散布装置を有する液 晶素子の製造装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶を用いた液晶素子 の製造方法、特に液晶パネルの基板間のギャップ厚を所 定の距離で、均一に作製するためのスペーサー粒子の散 20 布工程を有する液晶素子の製造方法及びその装置に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】従来のスペーサーの散布方法としては、 乾式散布方法と湿式散布方法がある。従来の乾式散布方 法とは、不活性気体を噴出させると同時にスペーサーを 気体中に分散させ、基板上に堆積させる方法である。湿 式散布方法は、スペーサーをアルコール等の溶媒に混合 分散させた混合液を霧状にし基板に散布する方法であ る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の乾 式散布方法では、スペーサーが帯電することによりスペ ーサーが凝集してしまう。また湿式方法では、同じく数 μm以下の小さなスペーサーにおいては凝集しやすく、 また基板上での溶媒が蒸発する時においても、凝集して しまう傾向があり、スペーサーが均一に分散されず、ギ ャップ精度が得られず、このスペーサーの凝集が配向乱 れの原因ともなり問題とされてきた。

【0004】本発明は前記従来技術の課題を解決するた 40 めに、非常に容易でかつ高度に均一にスペーサーを分散 させ、ギャップ精度の優れた液晶素子の製造方法を提供 することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明の第一のスペーサーの分散工程は、溶媒中に 分散したスペーサーを前記溶媒と共に基板上に塗布し基 板を回転させ溶媒を蒸発させ、前記基板上に均一にスペ ーサーを分散させることを特徴とする。

程は、溶媒中に分散したスペーサーを前記溶媒と共に、 髙速で回転させた基板上にスプレーした後、さらに基板 を回転させ溶媒を蒸発させ、基板上に均一にスペーサー を分散させることを特徴とする。

【0007】さらに、本発明の液晶素子の製造装置は、 基板を固定し回転することのできるステージと前記ステ ージの上部に液体を滴下することのできるノズルと、前 記ノズルと連結したスペーサーを分散させた溶液を保持 する容器とを具備していることを特徴とする。

10 [0008]

> 【作用】本発明によれば、あらかじめスペーサーを溶媒 中に分散させておいた混合分散液を基板表面に塗布し、 スピナー等を用いて基板を髙速回転させるか、または、 髙速回転させている基板にスプレーすれば良いため、非 常に容易でかつ高度に分散した状態のビーズ散布が可能 であり、また、それにより、ギャップ精度の優れた液晶 素子を製造することが可能となる。

[0009]

【実施例】本発明に用いる溶媒は配向膜に悪影響を与え るもの以外であれば何でもよいが、ビーズが溶媒中で凝 集してはいけないことから、極性の高い溶媒が良い。そ ういう意味では最もアルコールが用い易い。また基板の 回転中に溶媒が蒸発しないといけないこと、またあまり にも速く蒸発してしまうと分散液の塗布時間に分散濃度 が大きく依存し、再現性が悪くなることから、散布場所 の環境温度において、蒸気圧が3mmHg~50mmH gの溶媒が最も適している。

【0010】本発明に用いるスペーサーの形状には全く 制限がない。また、スペーサーの大きさも制限がなく、 強誘電性液晶素子に用いられる  $1 \mu m$ 程度のビーズであ 30 っても、非常に高度に分散可能である。特にこの場合、 従来の湿式法や乾式法では、ビーズの凝集が避けられな い領域であるため、本発明の分散法は非常に有効であ る。本発明で使用可能な基板の大きさは、1分間に10 00回転以上回転させることができる基板であれば本発 明の散布方法が使用可能なため、100インチや200 インチのような大きな基板であっても可能である。

【0011】また本発明の液晶素子の製造装置に使用す るスペーサーの分散装置は、図1に示すように、液体中 にスペーサー1を分散させて調製した分散液2を保持し ておく容器3とその分散液を取り出すためのノズル4が 連結管5でつながっており、そのノズル4の下部には基 板6を固定し回転させることのできるステージ7があ る。容器3には超音波発生装置(図示せず)が取り付け てあればさらにスペーサーの分散性は向上する。またノ ズル4はスプレー噴射、滴下の両方可能なノズルが望ま しい。

【0012】以下本発明の各実施例について説明する。 (実施例1) 成分がSiO2 からなる直径1. 0 μmの 【0006】また、本発明の第二のスペーサーの分散エ 50 球形のスペーサを  $5\,\mathrm{mg}$  とりイソブチルアルコール  $5\,\mathrm{0}$ 

m l を加え、超音波で1時間拡散させ、混合分散液を調製しこれを容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(55mm×65mm×1.1mm)をステージ4に設置し、先ほど調製した混合分散液をノズル2を通して基板表面に塗布し、3000 r pmで30秒回転させる。すると約1000個/mm²の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0013】次に同じく配向処理を施したガラス基板 (55mm×65mm×1.1mm) に接着剤をシール 印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を 10 貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚 が均一な液晶表示素子が得られるものである。

【0014】(実施例2)成分が $SiO_2$ からなる直径 0.8 $\mu$ mの球形のスペーサーを5mgとりイソプロピルアルコール50 m 1 を加え、超音波で 1 時間拡散させ、混合分散液を調製し容器 1 に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(55mm×65mm×1.1mm)をステージ4に設置し、先ほど調製した混合分散液を基板表面に塗布し、6000rpmで30秒回転させる。すると約1000個/mm²の密度で非常に均一に 20スペーサーが分散できる。

【0015】次に同じく配向処理を施したガラス基板(55mm×65mm×1.1mm)に接着剤をシール印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚が均一な液晶表示素子が得られる。

【0016】(実施例3)成分がSiO2からなる直径 0.8μmの球形のスペーサーを2mgとりプロピルアルコール50mlを加え、超音波で2時間拡散させて、混合分散液を調製し容器1に入れる。次に、配向処理を 30施したガラス基板 (500mm×500mm×5mm)をステージ4に設置し、先ほど調製した混合分散液を基板表面に塗布し、2000rpmで60秒回転させる。すると約300個/mm²の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0017】次に同じく配向処理を施したガラス基板(500mm×500mm×5mm)に接着剤をシール印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚が均一な液晶表示素子が得られる。

【0018】 (実施例4) 成分がSiO2 からなる直径 1.5 $\mu$ mの球形のスペーサーを5mgとり1ープタノール50mlを加え、超音波で1時間拡散させて、混合分散液を調製し、容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(100mm×100mm×1.5mm)をステージ4に設置し、先ほど調製した混合分散液を基板表面に塗布し、3000rpmで50秒回転させる。すると約1000個/mm² の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0019】次に同じく配向処理を施したガラス基板 50

(100mm×100mm×1.5mm) に接着剤をシール印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚が均一な液晶表示素子が得られる。

【0020】 (実施例5) 成分が $SiO_2$  からなる直径 1.  $0\mu$ mの球形のスペーサーを5mgとりイソプチルアルコール50m1を加え、超音波で1時間拡散させ、混合分散液を調製しこれを容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(55mm×65mm×1.1mm)をステージ4に設置し、3000rpmで300 回転させ、先ほど調製した混合分散液をノズル2を通して基板表面にスプレー散布し、さらに3000rpmで304 の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0021】次に同じく配向処理を施したガラス基板 (55mm×65mm×1.1mm) に接着剤をシール 印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚 が均一な液晶表示素子が得られる。

20 【0022】(実施例6)成分がSiO2 からなる直径 0.8μmの球形のスペーサーを5mgとりイソプロピルアルコール50mlを加え、超音波で1時間拡散させ、混合分散液を調製し容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(55mm×65mm×1.1mm)をステージ4に設置し、6000rpmで30秒回転させ、先ほど調製した混合分散液を基板表面にスプレー散布し、さらに6000rpmで30秒回転させる。すると約1000個/mm²の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

30 【0023】次に同じく配向処理を施したガラス基板 (55mm×65mm×1.1mm)に接着剤をシール 印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を 貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚 が均一な液晶表示素子が得られる。

【0024】(実施例7)成分がSiO2からなる直径 0.8μmの球形のスペーサーを2mgとりプロピルアルコール50mlを加え、超音波で2時間拡散させ、混合分散液を調製し容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板(500mm×500mm×5mm)を 40 ステージ4に設置し、2000rpmで30秒回転させ、先ほど調製した混合分散液を基板表面にスプレー散布し、さらに2000rpmで60秒回転させる。すると約300個/mm²の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0025】次に同じく配向処理を施したガラス基板 (500mm×500mm×5mm) に接着剤をシール 印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚 が均一な液晶表示素子が得られる。

【0026】(実施例8)成分がSi〇2 からなる直径

5

1.  $5 \mu$ mの球形のスペーサーを5 mgとり1 - J9/ール5 0 mlを加え、超音波で1時間拡散させ、混合分散液を調製し容器1に入れる。次に、配向処理を施したガラス基板( $1 0 0 mm \times 1 0 0 mm \times 1$ . 5 mm)をステージ4に設置し、3 0 0 0 r pmで3 0秒回転させ、先ほど調製した混合分散液を基板表面にスプレー散布し、さらに3 0 0 0 r pmで5 0秒回転させる。すると約1 0 0 0個/mm² の密度で非常に均一にスペーサーが分散できる。

【0027】次に同じく配向処理を施したガラス基板 10 (100mm×100mm×1.5mm) に接着剤をシール印刷し、先ほどのスペーサーを分散させたガラス基板を貼合わせ液晶を注入すると、非常に基板間のギャップ厚が均一な液晶表示素子が得られる。

#### [0028]

【発明の効果】以上のように本発明は、溶液中に分散させたスペーサーを基板上に塗布し、基板を高速で回転さ

せることにより、溶媒を蒸発させスペーサーを基板上に 均一に散布させるため、スペーサーの散布としては非常 に簡単であり、しかも高度に再現性良く分散させること が可能であるという特徴を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の液晶素子の製造装置におけるスペーサー散布装置の概略図

#### 【符号の説明】

- 1 スペーサー
- 10 2 分散液
  - 3 容器
  - 4 ノズル
  - 5 連結管
  - 6 基板
  - 7 ステージ
  - 8 基板回転装置

### 【図1】

- 3 2 4 6